

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

16.12.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年12月17日

RECEIVED	
06 FEB 2004	
WIPO	PCT

出願番号
Application Number: 特願2002-364820

[ST. 10/C]: [JP2002-364820]

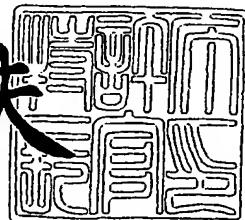
出願人
Applicant(s): シャランインスツルメンツ株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 1月22日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 SHA02P01
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G21K 1/06
【発明者】
【住所又は居所】 青森県八戸市鮫町福沢久保 13 シャランインスツルメンツ株式会社鮫事業所内
【氏名】 野田 昭夫
【発明者】
【住所又は居所】 青森県八戸市鮫町福沢久保 13 シャランインスツルメンツ株式会社鮫事業所内
【氏名】 小泉 有生
【特許出願人】
【住所又は居所】 東京都港区東麻布三丁目 7 番 9 号
【氏名又は名称】 シャランインスツルメンツ株式会社
【代理人】
【識別番号】 100119264
【弁理士】
【氏名又は名称】 富沢 知成
【電話番号】 0178-21-2111
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 145703
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学素子固定構造、光学素子固定体、光学素子および光学素子ホルダ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光学素子と、該光学素子を固定し搭載するための光学素子ホルダからなり、結晶等の光学素子を固定するための光学素子固定構造であって、該光学素子はその外縁部（光学素子上においてその作用面の外側にあって、該光学素子を光学素子ホルダに固定するための部位として用いることのできる部分をいう。以下同じ。）に厚さ方向にスリットが一または複数本設けられており、該光学素子ホルダは該光学素子の表面または裏面の少なくとも一方を該スリットの外側において押圧して該光学素子を固定するための押圧手段を備えていることを特徴とする、光学素子固定構造。

【請求項2】 前記押圧手段は、前記光学素子の裏面または表面いずれかの片面のみを押圧するものであることを特徴とする、請求項1に記載の光学素子固定構造。

【請求項3】 前記押圧手段は前記光学素子ホルダに取り付けられた弾性体であることを特徴とする、請求項1または2に記載の光学素子固定構造。

【請求項4】 前記光学素子の平面形状は、矩形、円形、橢円形、または三角形・平行四辺形・六角形等の多角形のいずれかであることを特徴とする、請求項1ないし3のいずれかに記載の光学素子固定構造。

【請求項5】 前記スリットは、前記光学素子の押圧歪みの素子作用面への伝播を防止するのに充分な深さを有することを特徴とする、請求項1ないし4のいずれかに記載の光学素子固定構造。

【請求項6】 前記スリットはその深さが、前記光学素子の厚さの半分以上の深さであることを特徴とする、請求項5に記載の光学素子固定構造。

【請求項7】 前記スリットは前記光学素子の表面と裏面の双方に設けられていることを特徴とする、請求項5または6に記載の光学素子固定構造。

【請求項8】 前記スリットは前記光学素子の表面と裏面に交互に設けられていることを特徴とする、請求項7に記載の光学素子固定構造。

【請求項9】 前記スリットは、少なくとも一端が前記光学素子の側面（表面と裏面をつなぐ面をいう。以下も同じ。）に開放している線状の構造であることを特徴とする、請求項5ないし8のいずれかに記載の光学素子固定構造。

【請求項10】 前記光学素子は矩形状であり、前記スリットは該光学素子の外縁部のうち少なくとも二箇所に、それぞれ一本ずつ設けられていることを特徴とする、請求項9に記載の光学素子固定構造。

【請求項11】 前記光学素子は矩形状であり、前記スリットは該光学素子の外縁部のうち少なくとも二箇所に、いずれも複数本設けられていることを特徴とする、請求項9に記載の光学素子固定構造。

【請求項12】 前記スリットは、円形や矩形等のように回路状または渦巻き状をなしていることを特徴とする、請求項5ないし8のいずれかに記載の光学素子固定構造。

【請求項13】 前記光学素子は円形状または橢円形状であることを特徴とする、請求項12に記載の光学素子固定構造。

【請求項14】 前記弾性体は板バネであることを特徴とする、請求項2ないし13のいずれかに記載の光学素子固定構造。

【請求項15】 前記弾性体は弾性体固定用ベースの表面に設けられ、該弾性体固定用ベースは前記光学素子ホルダの底部に設けられ、該弾性体固定用ベースの裏面にはこれを上下動させることによって該弾性体による押圧を調整することができる調整手段が、該光学素子ホルダを貫通して設けられていることを特徴とする、請求項2ないし14のいずれかに記載の光学素子固定構造。

【請求項16】 前記調整手段は調整ネジであり、前記弾性体の裏側に設けられていることを特徴とする、請求項15に記載の光学素子固定構造。

【請求項17】 前記光学素子はX線モノクロメータ用結晶であることを特徴とする、請求項1ないし16のいずれかに記載の光学素子固定構造。

【請求項18】 請求項1ないし17のいずれかに記載の光学素子固定構造を有する、光学素子固定体。

【請求項19】 請求項18に記載の光学素子固定体を構成することのできる、光学素子。

【請求項20】 請求項18に記載の光学素子固定体を構成することができ
る、光学素子ホルダ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は光学素子固定構造、光学素子固定体、光学素子および光学素子ホルダに関し、特に、固定ネジの締め付けを不要とすることによって結晶等の光学素子の取り付け精度を向上させることのできる、光学素子固定構造、光学素子固定体、光学素子および光学素子ホルダに関する。

【0002】

【従来の技術】

X線モノクロメータ用結晶などの光学素子をホルダに固定する場合、従来は素子の表面もしくは裏面側から固定ネジを用いた締め付けを行うことにより、行っていた。

【0003】

図7は、従来の光学素子固定方法を示す断面図である。図において従来は、結晶（光学素子）76を結晶ホルダ本体71の内側底部に設けられた基準面712上に載置し、ホルダ上枠711に貫設され下端に結晶76を直接押圧する固定プレート72の設けられた固定ネジ73を用いて、結晶76表面の両端部をそれぞれ締め付けることにより、これを固定していた。

【0004】

しかし、かかる従来の方法には次のような欠点があった。すなわち、

- (a) 固定ネジを用いた素子表面に対する締め付けにより、光学素子の平面性が悪化してしまい、光学素子としての性能が低下する。
- (b) 固定ネジを用いた素子表面に対する締め付けにより、光学素子に歪みが加わり、光学素子としての性能が低下する。
- (c) 複数用いる固定ネジによる締め付けは、上記の性能低下に加え、取り扱いに熟練を要する。
- (d) 温度変化などによりホルダや光学素子の膨張、収縮が生じると光学素子に

過大な応力が加わり、脆弱な光学素子の場合は破損するおそれがある。

【0005】

(e) 光学素子の固定位置の基準が素子裏面であるため、素子の厚さ公差やホールダ接触面の凹凸状態によって光学素子取り付け精度が低下する。

(f) 固定ネジによる固定の際には弾力のある有機物製スペーサを用いるのが定法だが、光学素子が搭載される測定機器によってはその処理すべき電磁波に対する耐性が充分でなく、その劣化による光学素子としての性能低下が生じる。たとえば、有機物は耐放射線性に劣るため、X線モノクロメータ用としては難点がある。

(g) 光学素子の取り扱いは熟練を要するため、結晶の取り扱いに不慣れな者にとって不便である。

【0006】

このような問題点を踏まえて従来技術をさらに検討した結果、幾ばくかの関連性が窺える若干の文献が検索された。このうち、特開平09-49899号公報に開示された「チャンネルカット結晶」では、底面を固定台に接着固定した場合にも二つの反射面の平行性を高精度に維持することを目的に、二つの反射面と底面との間の基台部分に、底面に平行な切り込みを形成するという手段を提案している。すなわち該考案のチャンネルカット結晶は、作用面ではなくその基台部分に底面に平行な二つの切り込みを設けることにより、接着部分から受ける応力や歪みの影響を及ぼしにくくなり低減し、反射面の平行性を高精度に維持できるとしている（特許文献1）。

【0007】

同様にスリット（切り込み）を設けることによって歪み伝播の防止を図る提案としては、圧力検出素子の周囲温度変化に対する安定性を得るためにチップ周辺固定部に溝を設ける「半導体ダイヤフラム」（特許文献2）、接着固定後の歪みや応力の影響を低減するために一方のプリズムのみを接着固定しつつ両プリズムの接合面近傍に溝を設ける「複合プリズム固定構造」（特許文献3）がある。

【0008】

【特許文献1】

特開平09-49899号公報。特許請求の範囲。発明の詳細な説明段落0004ないし0008。図面 図1、図2、図3、図5。

【特許文献2】

特開昭58-39069号公報。特許請求の範囲。図面 第1図ないし第4図。

【特許文献3】

実開平1-81613号公報。実用新案登録請求の範囲。図面 第1図。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら特許文献1に示されるチャンネルカット結晶についての提案は、結晶底面の固定は接着剤によることが前提であって、それによる歪みを低減することを目的として構成されている。つまり、ここで切り込みがなす作用は、接着剤による固定がなされることを前提に、底面の接着剤層の乾燥に伴い結晶基台部分に生ずる歪みが、結晶上部に設けられた光学素子としての作用面に伝播することを低減する作用である。一方、本願が先に課題として挙げたのは、一枚板状の光学素子のホルダへの搭載において、接着剤同様応力歪みの大きい固定手段である固定ネジによる固定方法を見直すことである。したがって、該技術をもって、一枚板状の光学素子など、より汎用的な形状の光学素子において、これを固定ネジによりホルダに固定する際の上記各問題点の解決手段とはできない。

【0010】

また、半導体ダイヤフラム、複合プリズムといった特殊な形状の素子に関する歪み応力吸収手段を開示する特許文献2、3の提案も、先の「チャンネルカット結晶」と同様に、一枚板状の光学素子など、より汎用的な形状の光学素子において、これを固定ネジによりホルダに固定する際の上記各問題点の解決手段とはできない。

【0011】

さらに光学素子の固定においては、歪みだけではなく、表面波や異常透過波の発生によるノイズの発生を防止することも重要である。

【0012】

本発明の課題は、前述した従来技術の欠点を解決し、固定ネジの締め付けを不要とすることによって、結晶等の光学素子の歪み発生など性能低下を防止し、取り付け精度を向上させることのできる、光学素子固定方法を提供することである。換言すれば、そのような方法を可能とする光学素子固定構造、光学素子固定体、光学素子および光学素子ホルダを提供することである。

【0013】

また本発明の課題は、一枚板状の光学素子など、より汎用的な形状の光学素子において、これを固定ネジによりホルダに固定する際の上記各問題点（平面性悪化、歪み発生による素子性能低下、破損危険性、取り付け精度低下、有機物スペーサの使用、取り扱いにおける熟練の必要。）を解決できる、光学素子固定構造、光学素子固定体、光学素子および光学素子ホルダを提供することである。

【0014】

さらに本発明の課題は、光学素子の固定において、表面波や異常透過波といったノイズをカットして光学素子の性能をより高めることのできる、光学素子固定構造、光学素子固定体、光学素子および光学素子ホルダを提供することである。

【0015】**【課題を解決するための手段】**

本願発明者は上記課題について鋭意検討した結果、弾性体などによる押圧手段を用いることによって上記課題を解決できることを見出し、本発明に至った。すなわち、上記課題を解決するための手段として本願で特許請求される発明は、以下のとおりである。

【0016】

- (1) 光学素子と、該光学素子を固定し搭載するための光学素子ホルダからなり、結晶等の光学素子を固定するための光学素子固定構造であって、該光学素子はその外縁部（光学素子上においてその作用面の外側にあって、該光学素子を光学素子ホルダに固定するための部位として用いることのできる部分をいう。以下同じ。）に厚さ方向にスリットが一または複数本設けられており、該光学素子ホルダは該光学素子の表面または裏面の少なくとも一方を該スリットの外側において

押圧して該光学素子を固定するための押圧手段を備えていることを特徴とする、光学素子固定構造。

【0017】

(2) 前記押圧手段は、前記光学素子の裏面または表面いずれかの片面のみを押圧するものであることを特徴とする、(1) の光学素子固定構造。

【0018】

(3) 前記押圧手段は前記光学素子ホルダに取り付けられた弾性体であることを特徴とする、(1) または(2) の光学素子固定構造。

【0019】

(4) 前記光学素子の平面形状は、矩形、円形、楕円形、または三角形・平行四辺形・六角形等の多角形のいずれかであることを特徴とする、(1) ないし(3) のいずれかの光学素子固定構造。

【0020】

(5) 前記スリットは、前記光学素子の押圧歪みの素子作用面への伝播を防止するのに充分な深さを有することを特徴とする、(1) ないし(4) のいずれかの光学素子固定構造。

【0021】

(6) 前記スリットはその深さが、前記光学素子の厚さの半分以上の深さであることを特徴とする、(5) の光学素子固定構造。

【0022】

(7) 前記スリットは前記光学素子の表面と裏面の双方に設けられていることを特徴とする、(5) または(6) の光学素子固定構造。

【0023】

(8) 前記スリットは前記光学素子の表面と裏面に交互に設けられていることを特徴とする、(7) の光学素子固定構造。

【0024】

(9) 前記スリットは、少なくとも一端が前記光学素子の側面（表面と裏面をつなぐ面をいう。以下も同じ。）に開放している線状の構造であることを特徴とする、(5) ないし(8) のいずれかの光学素子固定構造。

【0025】

(10) 前記光学素子は矩形状であり、前記スリットは該光学素子の外縁部のうち少なくとも二箇所に、それぞれ一本ずつ設けられていることを特徴とする、(9) の光学素子固定構造。

【0026】

(11) 前記光学素子は矩形状であり、前記スリットは該光学素子の外縁部のうち少なくとも二箇所に、いずれも複数本設けられていることを特徴とする、(9) の光学素子固定構造。

【0027】

(12) 前記スリットは、円形や矩形等のように回路状または渦巻き状をなしていることを特徴とする、(5) ないし (8) のいずれかの光学素子固定構造。

【0028】

(13) 前記光学素子は円形状または橢円形状であることを特徴とする、(12) の光学素子固定構造。

【0029】

(14) 前記弾性体は板バネであることを特徴とする、(2) ないし (13) のいずれかの光学素子固定構造。

【0030】

(15) 前記弾性体は弾性体固定用ベースの表面に設けられ、該弾性体固定用ベースは前記光学素子ホルダの底部に設けられ、該弾性体固定用ベースの裏面にはこれを上下動させることによって該弾性体による押圧を調整することができる調整手段が、該光学素子ホルダを貫通して設けられていることを特徴とする、(2) ないし (14) のいずれかの光学素子固定構造。

【0031】

(16) 前記調整手段は調整ネジであり、前記弾性体の裏側に設けられていることを特徴とする、(15) の光学素子固定構造。

【0032】

(17) 前記光学素子はX線モノクロメータ用結晶であることを特徴とする、(1) ないし (16) のいずれかの光学素子固定構造。

【0033】

(18) (1) ないし (17) のいずれかの光学素子固定構造を有する、光学素子固定体。

【0034】

(19) (18) の光学素子固定体を構成することのできる、光学素子。

【0035】

(20) (18) の光学素子固定体を構成することのできる、光学素子ホルダ。

【0036】

すなわち本発明の光学素子固定構造、光学素子固定体、光学素子および光学素子ホルダは、歪み応力吸収手段としてのスリット構造に加え弾性体などによる押圧手段を用いることによって、固定ネジの締め付けを不要とし、結晶等の光学素子の取り付け精度を向上させ、一枚板状の光学素子などより汎用的な形状の光学素子におけるホルダ固定の上記諸課題の解決手段を提供するものである。

【0037】

なお本発明はその構成により、歪み除去だけではなく、光学素子における表面波や異常透過波といったノイズをカットし、光学素子の性能を高めることができる。

【0038】**【発明の実施の形態】**

以下、本発明を図面により詳細に説明するが、本発明はこれらの図面に表されたものに限定されるものではない。

図1は、本発明の光学素子固定構造の構成を示す断面図である。図において本光学素子固定構造10は、光学素子6と、該光学素子6を固定し搭載するための光学素子ホルダ1からなり、結晶等の光学素子を固定するための光学素子固定構造10であって、該光学素子6はその外縁部に厚さ方向に、歪み応力吸収手段としてのスリット8が一または複数本設けられており、該光学素子ホルダ1は該光学素子6の表面または裏面の少なくとも一方を該スリット8の外側において押圧して該光学素子6を固定するための押圧手段3を備えていることを、主たる構成とする（請求項1）。

【0039】

図のように本光学素子固定構造10は、押圧手段3を該光学素子6の一方の面（図では裏面。）にのみ当接するように設け、他方の面（図では表面。）は、該光学素子ホルダ1の光学素子固定用の内周面（図ではホルダ上枠の内側の面）を固定用の基準面として用い、これに該光学素子6の面（図では表面）を当接させる構成とすることができる。

【0040】

ここで、光学素子の表面とは、光学素子として用いる部分である面（以下、「作用面」ともいう。）を有する側の面であり、図ではスリット8の設けられた面である（以下も同様。）一方、裏面とは表面の反対側の面である。

【0041】

また本発明において押圧手段とは、前述の従来方法における固定ネジのように、固定するための力が光学素子に局部的にのみ働く構造ではなく、多点的に働く手段をいう。これにより、光学素子を固定するための力が局部に集中することなく、歪み応力発生を低減ないしは防止することができ、結晶等光学素子に異常な歪みを生じさせることなく固定することができる。具体的には、後述する弾性体等が本発明の押圧手段に該当する。

【0042】**【作用】**

図1に示す構成をとることにより、本発明の光学素子固定構造10では、光学素子6は光学素子ホルダ1に固定、搭載されるが、該光学素子1はその端部に厚さ方向に設けられたスリット8の外側において、素子表面または裏面の少なくとも一方を、従来のような固定ネジを用いることなく押圧手段3により押圧されることによって、該光学素子ホルダ1に固定、搭載される。図のように、押圧手段3を該光学素子6の一方の面（図では裏面。）にのみ当接するように設け、他方の面（図では表面。）は該光学素子ホルダ1の光学素子固定用の内周面（図ではホルダ上枠の内側の面。）を固定用の基準面としてこれに当接させる構成とした場合は、該光学素子6は、一方の面（図では表面。）が該光学素子ホルダ1内周面（図ではホルダ上枠の内側。）に当接するように配置されつつ、他方の面（図

では裏面。) が該押圧手段3により押圧されることによって、該光学素子ホルダ1に固定、搭載される。

【0043】

図において前記押圧手段3および前記光学素子ホルダ1の内周面(ホルダ上枠など。)は、固定ネジのような局部的に力のかかる構造ではなく、多点的に力が働くものであるため、前記光学素子6における歪み応力の発生が低減ないしは防止され、該光学素子6における歪み発生が解消される。また、かかる固定は前記一または複数設けられたスリット8の外側(素子面上の外周側)においてなされるため、固定する圧力により発せする応力歪みは該スリット8に吸収され、作用面に対する応力歪みの伝播が低減ないし防止され、光学素子としての性能低下を防止することができる。

【0044】

図示するように、本発明の光学素子固定構造10は、前記押圧手段3を、上述のように前記光学素子6の裏面または表面いずれかの片面のみを押圧する構成とすることができる(請求項2)。すなわち本発明では、X線や可視光線など素子の表面に作用面を有する光学素子の場合は、表面を固定のための基準面とし、該光学素子の裏面のみを押圧する構成とすることができる。この場合、該光学素子6の表面(作用面を有する側の面)は、前記スリット8の外側(外縁部)において前記光学素子ホルダ1のホルダ上枠内側面を基準面としこれに当接して固定され、裏面は該押圧手段3により多点的に押圧、固定される。このように光学素子6の固定の基準を素子の表面側(作用面設置側)とすることにより、基準を裏面側としていた従来方法と比較して、素子の厚さ公差やホルダ接触面の凹凸状況による取り付け精度低下を防止し、その向上を図ることができる。

【0045】

一方、裏面が基準面となる光学素子の場合は、裏面を固定のための基準面とし、該光学素子6の表面のみを押圧する構成とすることができる。

【0046】

図において本発明の光学素子固定構造10は、前記押圧手段3を前記光学素子ホルダ1に取り付けられた弾性体とすることができます(請求項3)。本発明の弾

性体は、前記光学素子6の表裏面のうち少なくとも一面、望ましくは裏面に対する、多点的な押圧手段となる弾性体であれば、適宜のものを用いることができる。たとえば、ゴム、バネ、発泡セラミックス、発泡金属、エンジニアリングプラスティックス、ゲル状物質、気体などである。たとえば後述する板バネを用いることにより、本発明の押圧手段を簡易に構成することができる。

【0047】

押圧手段たる弾性体のうち、ゲル状物質としてはたとえばシリコン樹脂、また気体としては圧縮空気や、気体を吹き付ける機構により吹き付けられる気体などを用いることができる。

【0048】

また、本発明の光学素子固定構造をX線モノクロメータ用結晶としてなど、放射線を処理すべき電磁波とする測定装置に用いる場合は、耐放射線性など所定の条件を満たす弾性体を用いる。たとえば、バネ、発泡セラミックス、発泡金属、気体などであるが、後述する板バネを用いれば、本発明の押圧手段を簡易に構成することができる。

【0049】

弾性体として、バネ、発泡セラミックス、発泡金属、エンジニアリングプラスティックス、ゴム、ゲル状物質、気体などを材料にして、押圧点を多数設けた押圧体、あるいは平滑な押圧面を形成した押圧体を構成することにより、前記光学素子6に対する、固定のための押圧の分散、押圧される素子面上の押圧の均一化を図ることができ、歪み応力発生をより低減ないし防止することができる。

【0050】

図に示す形状に拘わらず、前記光学素子6の平面形状は、矩形、円形、橢円形、または三角形・平行四辺形・六角形等の多角形のいずれかとすることができます（請求項4）。すなわち図示する矩形状のみならず、自由な形状を採用することができる。これにより、たとえば光軸の断面形状と同じ橢円形状に素子を構成するなど、光学素子の性能向上を素子形状の観点から、種々に検討することが可能となる。

【0051】

本発明の光学素子固定構造10において、前記スリット8は、前記光学素子6の押圧歪みの素子作用面への伝播を防止するのに充分な深さとされる（請求項5）。すなわち、このような構成により押圧歪みの素子作用面への伝播を一層効果的に防止することができる。たとえばその深さは、該光学素子6の厚さの半分以上の深さとすることができる（請求項6）が、本発明はこれに限定されず、その光学素子が用いられる用途において充分な歪み伝播防止作用を奏することができる、適宜の深さを採用することができる。

【0052】

図2は、一の固定部分（外縁部）にスリットを複数設けた本発明の光学素子固定構造の構成を示す断面図である。図において本発明の光学素子固定構造20は、図1において示した各構成に加え、またはそれに替えて、該スリット18が前記光学素子16の表面と裏面の双方に設けられている構成とすることができる（請求項7）。図中、1は光学素子ホルダ、3は弾性体などの押圧手段である。これに拘わらず、本発明の光学素子固定構造では、複数のスリットが素子の表面か裏面いずれか一方の面のみに設けられる構成とすることもできる。

【0053】

図において前記スリット18は、前記光学素子16の表面と裏面に交互に設ける構成とすることもできる（請求項8）。スリットを表裏交互に設けることにより歪み応力吸収作用が大きくなり、押圧歪みの伝播をより一層防止することができる。交互に設けるスリット18の数は、図のように一箇所の固定用端部あたり表面、裏面それぞれ一本とすることも、また二本以上とすることも、もしくは表面には二本、裏面には一本とすることも、あるいはその逆のパターンとすることも、表裏面に交互に設ける他のパターンとすることもできる。かかる構成により、歪み応力吸収機能が一層高まり、該光学素子16表面上における応力歪み発生の低減ないし防止効果を一層向上させることができる。

【0054】

前記スリット18は、少なくともその一端が前記光学素子16の側面に開放している線状の構造とすることができます（請求項9）。すなわち本発明におけるスリット18は、その両端がともに該光学素子16の側面に開放され切り通しのお

うになった構造であってもよいし、あるいはその一端のみが開放されている構造であってもよい。これに拘わらず、該スリットはその両端とも該光学素子の側面に至らない構造とすることもできる。

【0055】

本発明の光学素子固定構造は、前記光学素子が矩形状であり、前記スリットは前出の図1のように、該光学素子の外縁部のうち少なくとも二箇所に、それぞれ一本ずつ設けられている構成とすることができる（請求項10）他、図2に示すように、該スリット18は該光学素子16の外縁部のうち少なくとも二箇所に、いずれも複数本設けられている構成とすることもできる（請求項11）。図1のように、該光学素子6の固定用部位（外縁部）に近接してスリット8をそれぞれ設け、前記押圧手段3を用いた固定を行うことにより、効果的に該光学素子6における歪み発生を低減ないし防止することができるが、図2のように、歪み応力吸收手段としてのスリット18を、該光学素子16上の固定用部位（外縁部）に近接してそれぞれ二本以上設けることにより、これが一本のみの場合と比較して、歪み応力吸收機能が高まり、該光学素子16表面上における応力歪み発生の低減ないし防止効果をさらに向上させることができる。

【0056】

図ではスリット18は、二箇所においてそれぞれ二本、表面、裏面に交互に設けられているが、本発明はこれに限定されず、三本以上のスリット数とすること、設ける場所を裏面か表面一方のみとすること、また裏面、表面に設けられるが交互ではない形態とすることもできる。

【0057】

また、スリットが設けられる位置は図のように向かい合う部位計二箇所とする他、たとえば矩形状の光学素子であれば、三辺、あるいは四辺すべてに設けることもできる。矩形以外の多角形や、円形・楕円形を光学素子形状として用いた場合も同様に、本発明におけるスリットは、向かい合う二箇所のみに限定されず、任意の外縁部上部位に、任意の総数で設けることができる。

【0058】

以上の説明に拘わらず、本発明の光学素子固定構造は、前記スリットが、円形

や楕円形、矩形等のように、回路状または渦巻き状をなしている構成とすることもできる（請求項12）。また、前記光学素子としては円形状または楕円形状のものを用い、かつ、円形や楕円形、あるいは矩形等のように、回路状または渦巻き状をなしているスリットを設けた構成とすることもできる（請求項13）。したがってたとえば、円形の光学素子に同心円をなす一または複数の円形状のスリットを設け、これを固定した構造とすることができます。

【0059】

本発明の光学素子固定構造は上述のように構成され作用するため、光学素子の歪みを除去できるだけではなく、表面波や異常透過波といったノイズをカットし、光学素子自体の性能を高めることができる。

【0060】

図3は、弾性手段として板バネを用いた本発明の光学素子固定構造の構成を示す一部欠切斜視図である。図において本発明の光学素子固定構造30は、前記押圧手段たる弾性体として板バネ23を用いる他は、図1、2を用いて説明した構成と同様のものとすることができます（請求項14）。図中、21は光学素子ホルダ、26は光学素子、28はスリットである。押圧手段として板バネ23を用いることにより、簡易に多点的な押圧固定を該光学素子26に対して行うことができ、簡易に応力歪みの伝播を防止し、取り付け精度向上等を図ることができる。

【0061】

図4は、押圧を調整する調整手段を設けた本発明の光学素子固定構造の構成を示す断面図である。図において本発明の光学素子固定構造40は、前記弾性体33を弾性体固定用ベース35の表面に設けることとし、該弾性体固定用ベース35は前記光学素子ホルダ31の底部に設け、該弾性体固定用ベース35の裏面にはこれを上下動させることによって該弾性体33による押圧を調整することができる調整手段34を、該光学素子ホルダ31を貫通して設ける構成とすることができる（請求項15）。図中、36は光学素子、38はスリットである。

【0062】

図において本発明の光学素子固定構造40は上述のように構成されているため、前記光学素子ホルダ31の底部に固設された前記弾性体固定用ベース35の表

面に設けられた弾性体33により、前記光学素子36は押圧されて固定される。そして該弾性体固定用ベース35は、その裏面に設けられた前記調整手段34における上下動を起こす調整により上下動させられ、それに伴いこれに設けられた該弾性体33が上下動させられて、該弾性体33による押圧を受ける該光学素子36に対する押圧が調整される。かかる作用により、押圧手段たる該弾性体33による押圧の分布を変化させることができ、光学素子固定の際に発生する各種歪みを最小とするような調整を行うことができる。

【0063】

図において前記調整手段34は、適宜の位置に適宜の数設けることができる。したがって、前記弾性体固定用ベース35の中央付近など、前記弾性体33位置とは離れた部分に設けることもできるが、図のように、前記光学素子36の固定用の両端部に対し押圧の調整ができるよう、各端部位置に対応して少なくとも一個ずつ設ける構成とすることもできる。また、各端部位置に対応して、二個または三個以上設けることとすることもできる。設ける数をある程度多くすることにより、押圧分布の調整をより細かく行うことができ、光学素子固定の際に発生する各種歪みを、より少なくすることができます。

【0064】

図において本発明の光学素子固定構造40では、前記調整手段34としてはネジを用い、これを前記弾性体33の裏側に設けた構成とすることができる（請求項16）。すなわち、板バネ等の弾性体33を固定するための弾性体固定用ベース35を、背面側からのネジの回転操作により上下動させ、該弾性体33による前記光学素子36に対する押圧を所定の位置で増減させて、光学素子固定の際の歪み発生を最小のものとすることができます。

【0065】

上述の構成および作用により、本発明は、X線モノクロメータ用結晶（プローブ用、およびアナライザ用の両者を含む。）（請求項17）、他のモノクロメータ用結晶など、測定機器に幅広く使用することができる。

【0066】

【実施例】

以下、本発明を実施例により説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

<実施例1>

本発明の光学素子固定構造を用いて光学素子固定体を構成することができる。図5は、本発明の光学素子固定体の実施例についてその構造を示す写真図である。図において本光学素子固定体500は、光学素子46を固定、搭載した、上述のいずれかの光学素子固定構造50と、これを支持固定する固定部59とから構成される（請求項18、19、20）。上述した本発明の光学素子固定構造50は、光学素子46が光学素子ホルダに固定、搭載された形態をとることにより、精密研磨された結晶等光学素子の取り扱いを容易なものとすることができますが、さらに本例のように光学素子固定構造50を固定部59に固定することにより、さらにその取り扱い性を向上させることができる。

【0067】

また、固定部59の中心軸上に光学素子46の作用面が一致する配置とすることにより、本例の光学素子固定体500を回転ゴニオに取り付けて使用する場合、角度によって作用面上のX線等処理すべき電磁波、電子線、中性子線、 α 線、 β 線、その他の粒子線の照射位置が変化してしまうという問題を防止することができる。

【0068】

図6はなお、本例の光学素子固定体を測定機器の光学テーブル上に搭載した例を示す側面図である。図のように、光学テーブル上に設けられた直線スライド、回転ゴニオヘッド（シータ回転）、スイベルゴニオヘッド（チルト回転、ファイ回転）からなる機構上に、本例の光学素子本体を搭載した光学素子固定体を設置して用いることができる。

【0069】

【発明の効果】

本発明の光学素子固定構造、光学素子固定体、光学素子および光学素子ホルダは上述のように構成されているため、固定ネジの締め付けを不要とし、それによって結晶等の光学素子の歪み発生など性能低下を防止し、取り付け精度を向上さ

せることができる。

【0070】

また、一枚板状の光学素子など、より汎用的な形状のものを含む光学素子において、これを固定ネジによりホルダに固定する際の各問題点（平面性悪化、歪み発生による素子性能低下、破損危険性、取り付け精度低下、有機物スペーサの使用、取り扱いにおける熟練の必要。）を解決することができる。

【0071】

また、光学素子の歪みを除去できるだけではなく、表面波や異常透過波といったノイズをカットし、光学素子自体の性能を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の光学素子固定構造の構成を示す断面図である。

【図2】 スリットを複数設けた本発明の光学素子固定構造の構成を示す断面図である。

【図3】 弾性手段として板バネを用いた本発明の光学素子固定構造の構成を示す一部欠切斜視図である。

【図4】 押圧を調整する調整手段を設けた本発明の光学素子固定構造の構成を示す断面図である。

【図5】 本発明の光学素子固定体の構造を示す写真図である（実施例1）。

【図6】 本発明の光学素子固定体を測定機器の光学テーブル上に搭載した例を示す側面図である（実施例1）。

【図7】 従来の光学素子固定方法を示す断面図である。

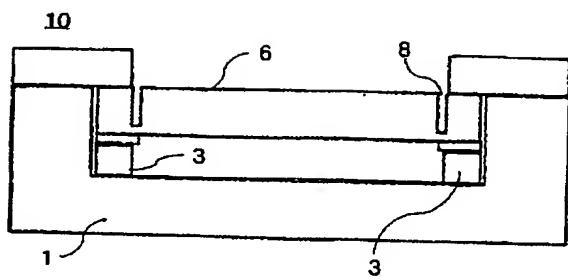
【符号の説明】

1、21、31、41…光学素子ホルダ、 3、23、33…押圧手段、
6、16、26、36、46…光学素子、 8、18、28、38…スリット、
10、20、30、40、50…光学素子固定構造、 34…調整手段、 35
…弹性体固定用ベース、 59…固定部、 500…光学素子固定体、 71…
結晶ホルダ単体、 711…ホルダ上枠、 712…基準面、 72…固定プレ
ート、 73…固定ネジ、 76…結晶（光学素子）

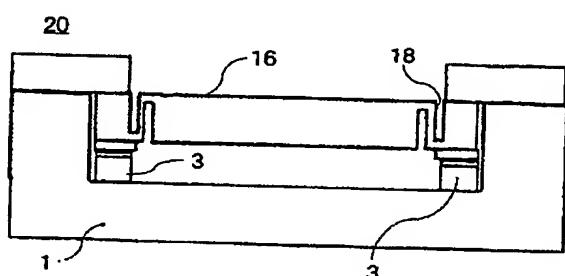
【書類名】

図面

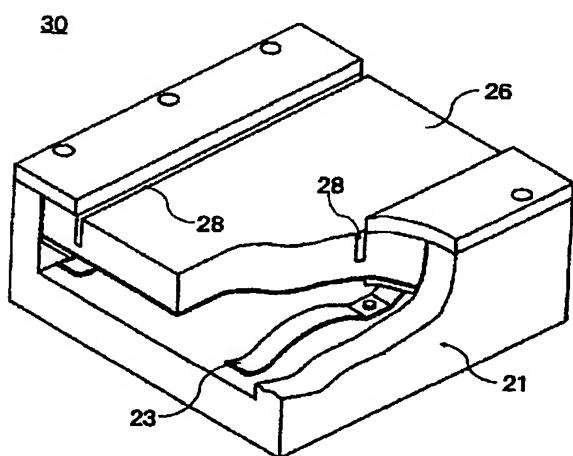
【図 1】



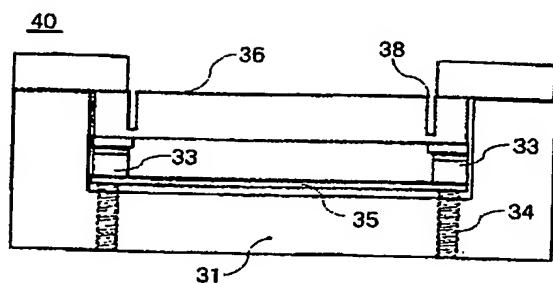
【図 2】



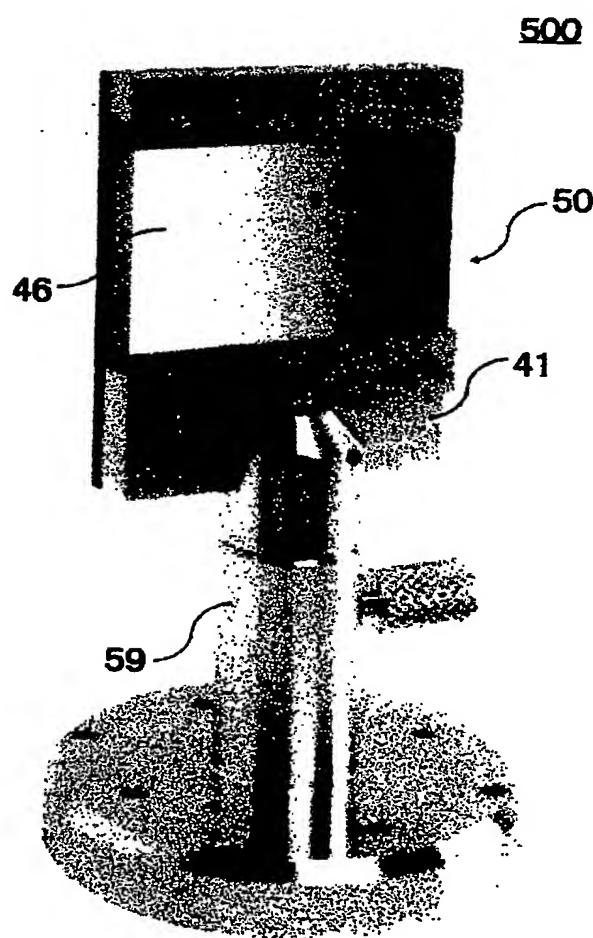
【図 3】



【図4】



【図5】

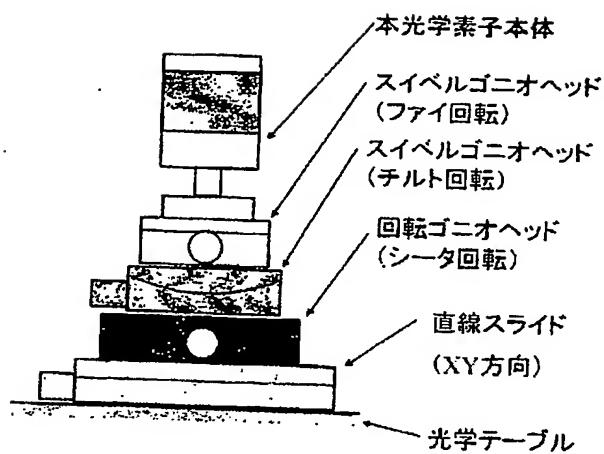


特願2002-364820

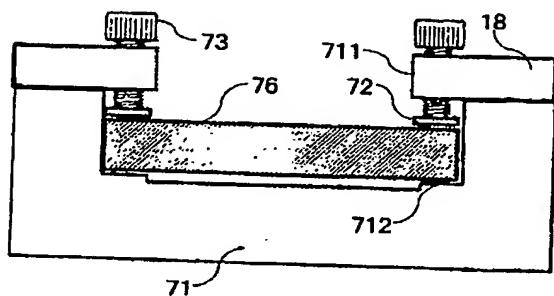
ページ： 3/

出証特2003-3112455

【図6】



【図7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 固定ネジの締め付けを不要とし、それによって結晶等の光学素子の歪み発生など性能低下を防止し、取り付け精度を向上させることのできる光学素子固定構造、光学素子固定体、光学素子および光学素子ホルダを提供すること。

【解決手段】 光学素子固定構造10は、光学素子6と、該光学素子6を固定し搭載するための光学素子ホルダ1からなり、該光学素子6はその端部に厚さ方向に、歪み応力吸収手段としてのスリット8が一または複数本設けられており、該光学素子ホルダ1は該光学素子6の表面または裏面の少なくとも一方を該スリット8の外側において押圧して該光学素子6を固定するための押圧手段3を備えた構成とする。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-364820
受付番号	50201907606
書類名	特許願
担当官	伊藤 雅美 2132
作成日	平成15年 1月14日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成14年12月17日
-------	-------------

次頁無

出証特2003-3112455

特願2002-364820

ページ： 1/E

出願人履歴情報

識別番号 [502455315]

1. 変更年月日 2002年12月17日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都港区東麻布三丁目7番9号
氏 名 シャランインスツルメンツ株式会社